



■ 特長

- ・デスクトップ型で低価格ターボ式真空蒸着装置
- ・操作性重視(排気系・蒸着源)の抵抗加熱式蒸着装置
- ・スピーディーに高真空状態が可能で TEM・SEM・EPMA 用の前処理作製が可能
- ・カートリッジホルダの選択で薄膜デバイス/電極膜作製装置として使用可能

TEM・SEM・EPMA 用前処理装置/薄膜・電極膜作製装置

真空蒸着装置

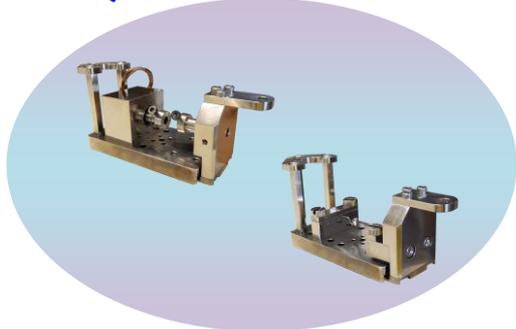
Model LA-V5050

【基本仕様】	
蒸着方式	抵抗加熱方式
排気操作方式	TMP+RP 直結型排気方式
真空槽(チャンバー)	約φ160(内径)×200(高さ)mm : アルミ製
到達真空度	約 5×10^{-4} Pa 以下/約1時間 ^(注1)
排気ポンプ	TMP : 67L/s (N2) RP : 20L/min ※RP 自動リーク付・オイルミストトラップ付
内部治具	防着板・電極棒・カートリッジ式ホルダ
蒸着電源	0~15V/0~80A (Max1200W) スwitching方式
外観寸法	本体 : 約 300(W) × 450(D) × 460(H) mm 蒸着電源(PS) : 約 300(W) × 450(D) × 250(H) mm RP : 約 156(W) × 295.5(D) × 199.5(H) mm
装置質量	約 35kg/本体(+RP:約9kg+PS:約15kg)
設置電源	単相 AC100V±10% (50/60Hz) 1.5KVA D種接地 3P コンセント(1m)
設置室温/湿度	25±10°C/45~85%以下(結露なきこと)

真空槽(チャンバー)



カートリッジ式ホルダ



※本仕様は、性能改善のため予告なく変更されることがあります。
※注1:設置室条件・使用状況・真空槽内等の条件/状態と異なることがあります。

■ オプション

- ・基板回転傾斜ユニット
- ・ガス導入ユニット MFC/ニードルバルブ
- ・水晶振動子式膜厚モニタ
- ・各種カスタマイズ機構対応可能

卓上型

実機サイズ比較例

比較対象：携帯電話



ラボテック株式会社

〒167-0043 東京都杉並区上荻2-27-13

TEL : 03-3397-0431 FAX : 03-3301-1845

<http://www.labotec.tokyo/>